MODULARIO LCA - 101



Rec'd PCT/PTO 09 MAY 2005 PCT / 1 B 0 4 / 0 0 5 6 3

REC'D 0 2 APR 2004

## Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la CompetitivIta Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Ufficio G2

10,33 Euro

Autenticazione di copia di documenti relativi alla domanda di brevetto per:

Invenzione Industriale

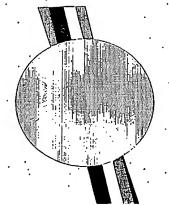
TO2003 A 000166

Si dichiara che l'unita copia è conforme ai documenti originali depositati con la domanda di brevetto sopraspecificata, i cui dati risultano dall'accluso processo verbale di deposito.

## PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2 3 MAR. 2004



IL FUNZIONARIO

Giampietro Carlotto Gialifico los los los

BEST AVAILABLE COPY

AL MINISTERO DELL'INDE LA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI - ROMA DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE. DEPOSITO RISERVE, ANTICIPATA ACCESSIBILITÀ A	MODULO A marca da bolto
A. RICHIEDENTE (I) C.R.F. Società Consortile per Azioni	M.G.
Orbassano - TO	. 07084560015
2) Congrations	P7984560015
Residenza	
B. RAPPRESENTANTE DEL RICHIEDENTE PRESSO L'ULB.M.	
cognome name NOTARO GIANCARLO ed altri	ale <u>L</u>
denominazione studio di appartenenza BUZZI, NOTARO & ANTONIELLI d'OULX SRL	
C. DOMICILIO ELETTIVO destinatario	cap [19123] (prov) [T9
via L L L città L L L città L L L L	
D. TITOLO Circus connects leavielled 1 1 1 1 amontone to 1 11 1 .	. 1
"EMETTITORE AD ALTA EFFICIENZA PER SORGENTI DI LUCE AD INCANDE	SCENZA"
ANTIGIPATA ACCESSIBILITÀ AL PUBBLICO: SI 🔲 NO 🖹 SE ISTANZA: DATA LL/LL/	Nº PROTOCOLLO
E. INVENTORI DESIGNATI COMPANIO	egnome some
PULLINI, Daniele BRIGNONE, Mauro	
F. PRIORITÀ	
pazione o organizzazione tipo di priorità numero di domanda data di deposito SR	SCIOGLIMENTO RISERVE Data Nº Protocolis
': 11 L L/ L/ L/ L// L/ L/ L// L/ L/ L// L/ L// L/ L// L// L/ L// L	الماليالياليال.
2)	اسا/اسا/اسسیا
G. CENTRO ABILITATO DI RACCOLTA COLTURE DI MICRORGANISMI, denominazione	MATICADARIOREO
n. AdaOTAZIONI SPECIALI	
	CAMERA DI CO MANA DI COMPANI DI INDUSTRIA ARTA AL CAMERA DI TORINO
MANUSCHELLER STATES	S W
Volas Efford	
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA	
N. es.	SCIOGLIMENTO RISERVE Data Nº Protocalio
11. Compare ( and insperior of the compare)	
Doc. 2) [ PROV n. tav 15 disegno lobbligatorio se citato in descrizione, 1 esemplara	السلاما
Occ. 3) L1 LRS lettera d'incarico, protura o riferimento procura generale	
Doc. 5) . documenti di priorità con traduzione in italiano	
Doc. 6) L RS autorizzazione o atto di cassione	confronts singula priorità
Occ. 7) U nominativo completo del richiedente	
B) attestati di versamento, totale lire (© QUATTROCENTOSETTANTADUE/56 (© 472,56)	obbligatorio J
	OTARO
11 - 17 7 7 7 7	<b>b</b> sb /
DEL PRESENTE ATTO SI RICHIEDE COPIA AUTENTICA SUNO LSI	(ki/oltri)
CAMERA DI COMMERCIO LA A. DI TORINO	codice [93]
VERBALE DI DEPOSITO NUMERO DI DOMANDA	
L'anno millanovacanto DUEMILATRE , il giorno SEI	dal mese di   MARZO
il(i) richiedante(i) sopraindicato(i) ha(hanno) presentato a me sottoscritto la presente domanda, corredata di n.	r la concessione del brevetto soprariportato.
I. AHMOTAZIONI VARIE DELL'UFFICIALE ROGANTE	I. del mese di MARZO  ria concessione del bravatto soprariportato.
AND STREET	
IL DEPOSITANTE AND ANTICOLOR	L'UFFICIALE ROGANTE
Cappy	
All	- Land
	CATECODIC

REST AVAILABLE COPY

FOGLIO AGGIUNTIVO n. 1-1	DOMANDA N.	L		. 6				. 1 .	AG EG. A	GIUN'	TA MC	DULO A
A. RICHIEDENTE (I)		70	0	<u></u>	7	A	0	_		æ	6	N.G.
Denominazione L		IA	<i>k</i> .	U	03	) A	0	0 (	) 1	6	O.	
Residenza						الــــ	dice	سيا		1.1.1		
Li Danominazione												
Residenza						_] ==	dise	يبيا	<u></u>	1.1.1	1.1.1.	
Denominazione												
Residenza						_  _	dice	سا	111	111	ш.	لسب
Denominatione L					<u> </u>							ليا لـ
Residenza						‱ لـ	dice	LLL				لبب
LL Cenominazione	•				<u> </u>							لـلا لــ
Residenza							dice	LLL				لتس
Cenominazione												لبا لــا
Residenza	<del></del>					<b>」</b> ∞	dice	لبب				ليبي
E. INVENTORI DESIGNATI	•											
LOS LAMBERTINI, Vito	_	.00	LI PI	neme N C	Malla							
[97] PERLO, Piero		तिव	LITI	ιζΑ,	146110	,						
Lill		اللا	<u> </u>									
		اليا	<u> </u>								<del></del>	
	l	اللا	<u>ـــــ</u>			<del></del> :				<del></del> -		
	<del></del>	البا	\ I									
			l									
ш			l									
LUL			1		•							
LUL												
F. PRIGRITÀ							$\overline{}$		SUME	MENTO	RISERVE	
nazione o organizzazione tipo di priorità	nomero di don	nanda	data di de	posito		allegat	•		ita	IM EN CU	Nº Prote	1
LJ [] [	ــــا لـــــا	:	ا/لىا	انلد	سا	لاً لـ	Ι.	_ا/ك	_ا/ك	ــا/ـــ		
LU L L	ـــــا ل		سالسا	االد	سيا	ט ע	1	با الب	ـا/ك	ــا/لــ		
LU L L	J L		االبا	الل	سا	ں ب	L	با/لند	سا/ل	ИL		ابب
LU L	ـــــا ل		االبا	ا/لـد	سا	ں ب	L	با/لىد	سارل	ا/ل	ш.	البيا
LU	J L				سا		L	با/ل	<b>ا/</b> ل	سا/لــ		الب
	J L		االيا	الا	سا	u L	L	<u>ا/لـ</u>	ا/ك	_ا/ل_		لبيا
	TARO-											
N Jecely (AIBO 104	7										·	لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
L lin proprio e per ofi	oliri)				<u> </u>					<u> </u>		

Un emettitore per sorgenti di luce ad incandescenza, in particolare un filamento, suscettibile di essere portato all'incandescenza tramite passaggio di corrente elettrica è realizzato in modo da avere un valore di assorbimento spettrale □ alto nella regione visibile dello spettro e basso nella regione infrarossa dello spettro, detto assorbimento □ essendo definito come □=1-□-□, dove □ è la riflettanza spettrale e □ è la trasmittanza spettrale dell'emettitore stesso.



M. DISEGNO

L. RIASSUNTO

**DESCRIZIONE** dell'invenzione industriale dal titolo: "Emettitore ad alta efficienza per sorgenti di luce ad incandescenza"

di: C.R.F. Società Consortile per Azioni, nazionalità italiana, Strada Torino 50 - 10043 Orbassano (TO).

Inventori designati: Piermario REPETTO Daniele

PULLINI, Davide CAPELLO, Mauro BRIGNONE, Vito LAMBERTINI, Nello LI PIRA, Piero PERLO.

Depositata il: 6 Marzo 2003 70 2003 A 000166

## TESTO DELLA DESCRIZIONE

presente invenzione ha per oggetto un emettitore per sorgenti di luce ad incandescenza, in particolare un filamento, suscettibile di essere all'incandescenza portato tramite passaggio di corrente elettrica.

Come noto, le tradizionali lampade ad incandescenza sono dotate di un filamento di tungsteno (W) che viene reso incandescente dal passaggio di corrente elettrica. L'efficienza delle lampade ad incandescenza tradizionali è limitata dalla legge di Planck, la quale descrive l'intensità spettrale  $I(\lambda)$  della radiazione emessa dal filamento di tungsteno della lampada alla temperatura T di equilibrio, e dalle perdite di calore per conduzione

e convezione. L'energia irradiata dal filamento in tungsteno nell'intervallo visibile dello spettro elettromagnetico è proporzionale all'integrale della curva  $I(\lambda)$  tra  $\lambda_1=380$  nm e  $\lambda_2=780$  nm.

Secondo la legge di Kirchoff, sulla quale si basa la presente invenzione, in condizioni di equilibrio termico la radiazione elettromagnetica assorbita da un corpo ad una specifica lunghezza d'onda è pari alla radiazione elettromagnetica emessa.

Una conseguenza diretta di questa legge è che l'emittanza spettrale "s" di una superficie coincide l'assorbanza spettrale "α". L'assorbanza spettrale " $\alpha$ " è a sua volta legata alla riflettanza spettrale " $\rho$ " e alla trasmittanza spettrale attraverso la relazione  $\alpha=1-\tau-\rho$ , da cui discende la relazione  $1-\varepsilon=\tau+\rho$ . Per un materiale opaco, sostanzialmente nulla e la riflettanza spettrale  $\rho$  $(1-\varepsilon)$ ; si osservi, tuttavia, coincide con qualunque materiale per spessori sufficientemente piccoli ha una trasmittanza spettrale  $\tau$  diversa da 0.

La relazione  $\tau+\rho=1-\epsilon$  dice implicitamente che, se la superficie di un corpo opaco ha una bassa riflettanza spettrale ad una data lunghezza d'onda, la corrispondente emissività spettrale sarà molto alta; viceversa, se la riflettanza spettrale è alta,

l'emissività corrispondente sarà bassa.

Emissività, assorbanza, trasmittanza e riflettanza sono funzione, oltre che della lunghezza d'onda, anche della temperatura T e dell'angolo di incidenza/emissione  $\theta$ , ma le relazioni sopra esposte valgono per qualsiasi T, qualsiasi lunghezza d'onda e qualsiasi angolo, in quanto discendono da pure considerazioni termodinamiche. In generale la relazione  $\tau+\rho=1-\epsilon$  può quindi essere riscritta come

 $\tau (\lambda, T, \theta) + \rho(\lambda, T, \theta) = 1 - \epsilon(\lambda, T, \theta)$ .

Le curve di riflettanza e trasmittanza spettrale ad una data temperatura T, da cui discendono i valori di assorbanza e di emissività a tale temperatura, possono essere calcolate a priori attraverso le costanti ottiche (sempre a temperatura T) del materiale o dei materiali costituenti l'emettitore per una qualsiasi geometria dell'emettitore stesso e per qualsiasi angolo di incidenza/emissione.

Le costanti ottiche del materiale sono i valori reale n ed immaginario k dell'indice di rifrazione; i valori di n e k per la maggior parte dei materiali noti sono stati misurati sperimentalmente e sono disponibili in letteratura. Non esistono in generale valori di n e k disponibili alle temperature di interesse per sorgenti ad incandescenza. I calcoli di

riflettanza e trasmittanza, presentati nel seguito della descrizione е nelle relative figure, riferiscono a costanti ottiche misurate a temperatura ambiente; tuttavia, le considerazioni fatte hanno validità generale е possono essere facilmente trasferite al caso di alte temperature.

In una sorgente ad incandescenza tradizionale la radiazione viene emessa da un filamento in tungsteno, la cui temperatura operativa è intorno ai 2800K; la radiazione emessa segue la legge del corpo nero, il cui spettro corrispondente è dato dalla relazione di Planck. Il filamento può essere con buona approssimazione considerato un corpo grigio, ossia con emissività costante in tutto lo spettro interesse. Per definizione, un corpo nero è un corpo grigio con emissività  $\epsilon(\lambda, \; T, \; \theta)$  indipendente da  $\lambda$  e da  $\theta$  e pari al 100% (valore massimo). Lo spettro di emissione di un corpo grigio si può ottenere moltiplicando lo spettro di corpo nero I( $\lambda$ ) relazione di Planck) per il valore emissività  $\epsilon(T)$ . Per un corpo non-grigio, la curva di Planck I( $\lambda$ ) va invece moltiplicata per una curva di emissività spettrale  $\epsilon(\lambda, T, \theta)$ .

L'emissività spettrale del tungsteno è in generale funzione della temperatura; empiricamente è



stato dimostrato che l'emissività media del tungsteno segue la relazione

 $\varepsilon_{m}(T) = -0.0434 + 1.8524 * 10^{-4} * T - 1.954 * 10^{-8} * T^{2}$ .

Alle basse temperature la curva di emissività spettrale può essere facilmente ricavata misurando lo spettro di riflettanza del tungsteno ed applicando la relazione  $\varepsilon(\lambda, T, \theta) = 1 - \rho(\lambda, T, \theta)$ ; alle temperature incandescenza questo tipo di di misura diventa impraticabile, in quanto lo spettro di riflettanza e quello di emissione sono ovviamente mescolati. Alla temperatura di 2800K, l'emissività media del tungsteno è circa uguale al 30%, il che corrisponde ad una riflettanza media pari a circa il 70%. A 2800K, il picco nello spettro di emissione si ha ad una lunghezza d'onda di poco superiore ad 1 micron, il che presuppone che maggior la parte radiazione viene emessa in forma di infrarosso. In particolare, per un corpo grigio a temperatura 2800K, poco meno del 10% della radiazione è emesso nello spettro visibile (380-780 nm), mentre oltre il 20% viene emesso nell'infrarosso vicino (780-1100 nm). In realtà il filamento di tungsteno non è un corpo grigio vero e proprio, ma ha una emissività spettrale pressappoco costante nel visibile. che tende diminuire significativamente nell'infrarosso vicino,

come evidente dalle curve di riflettanza e emissività spettrale riportate in figura 1. Nel grafico di figura 1, le curve CR е CE rappresentano rispettivamente la riflettanza e l'emissività del tungsteno temperatura ambiente per diverse lunghezze d'onda nello spettro visibile e vicino infrarosso. Questo fa sì che l'efficienza di filamento di tungsteno, intesa come rapporto tra radiazione visibile e radiazione complessivamente emessa, sia decisamente superiore a quella di corpo grigio; il vantaggio è ancora più significativo se si considera l'emissività spettrale del tungsteno a temperatura ambiente.

La figura 2 mette a confronto la curva di Planck a 2800K, indicata con CP, con la potenza spettrale emessa da un filamento di tungsteno a 2800K; per il tungsteno, il grafico riporta sia i valori misurati sperimentalmente (curva PM), sia i valori calcolati utilizzando le costanti ottiche del tungsteno a temperatura ambiente (curva PC).

Tuttavia, va osservato come l'efficienza complessiva di una sorgente ad incandescenza, intesa come rapporto tra potenza luminosa irradiata e potenza elettrica dissipata, sia di fatto ridotta da ulteriori fattori dissipativi, in particolare le

perdite per convezione dal filamento verso il bulbo e le perdite per conduzione lungo i reofori della lampada.

Le perdite per conduzione si possono generalmente ridurre aumentando il rapporto tra lunghezza sezione del filamento. Le perdite per convezione si virtualmente eliminare mantenendo filamento nel vuoto; ai fini pratici questa soluzione è però inattuabile, a causa del fatto che il tasso di evaporazione del tungsteno nel vuoto è troppo elevato non garantisce una vita media della lampada sufficientemente lunga. Lo sforzo per minimizzare le perdite di calore ha quindi portato alla forma a doppia spirale, attualmente utilizzata nella stragrande maggioranza delle sorgenti ad incandescenza. Le lampade alogene sfruttano invece meccanismi particolari che permettono di portare il filamento a temperature maggiori, spostando così il picco di emissione verso la regione visibile dello spettro ed aumentando l'efficienza luminosa della sorgente.

Sulla base di quanto sopra esposto, la presente invenzione si propone di realizzare un emettitore per sorgenti ad incandescenza, suscettibile di essere portato all'incandescenza tramite un passaggio di

corrente elettrica, avente un'efficienza superiore a quella dei filamenti per lampade ad incandescenza ottenuti con tecniche tradizionali.

In breve, l'invenzione prevede l'impiego di un emettitore in materiale conduttore o semiconduttore, quindi suscettibile di essere portato all'incandescenza tramite passaggio di corrente elettrica, realizzato in modo da avere un valore di assorbimento spettrale  $\alpha$  alto nella regione visibile dello spettro e basso nella regione infrarossa dello spettro (lunghezze d'onda superiore a 780 nm), detto assorbimento  $\alpha$  essendo definito come  $\alpha {=} 1 {-} \rho {-} \tau,$  dove  $\rho$ è la riflettanza spettrale e au è la trasmittanza spettrale dell'emettitore stesso.

La caratteristica di assorbimento spettrale dell'emettitore secondo l'invenzione può essere ottenuta attraverso la combinazione tra le proprietà ottiche dei materiali che lo costituiscono con una sua particolare geometria.

In una possibile implementazione, gli scopi della presente invenzione possono essere raggiunti attraverso l'utilizzo di un materiale conduttore, ad esempio un metallo, opaco sia nel visibile sia nell'infrarosso ( $\tau$ =0), e dotando tale conduttore con mezzi antiriflesso operanti per ridurre la



riflettanza  $\rho$  nella regione visibile dello spettro, pur mantenendo elevata o addirittura aumentando la riflettanza  $\rho$  nel vicino infrarosso.

Tali mezzi antiriflesso possono essere, ad esempio, rivestimenti dielettrici a uno o più strati del materiale che realizza l'emettitore; le proprietà antiriflesso possono anche essere ottenute attraverso una opportuna microstrutturazione della superficie dell'emettitore, o ancora attraverso una combinazione microstrutturazione e rivestimento dielettrico multistrato. In alternativa, gli scopi dell'invenzione possono essere raggiunti realizzando l'emettitore con un sottile strato di materiale semiconduttore, avente bassa riflettanza  $\rho$  sia nel visibile sia nell'infrarosso, alta trasmittanza  $\tau$ nell'infrarosso vicino e bassa trasmittanza  $\tau$  nel visibile; come risulterà chiaro in seguito, questa caratteristica alle alte temperature è tipica dei semiconduttori con grande banda proibita o "bandgap", quali ad esempio il carburo di silicio (SiC).

Caratteristiche specifiche preferite dell'invenzione sono indicate nelle rivendicazioni allegate, che si intendono parte integrante della presente descrizione.

Ulteriori scopi, caratteristiche e vantaggi

dell'invenzione risulteranno chiariti dalla descrizione che segue, effettuata con riferimento ai disegni annessi, forniti a puro titolo di esempio non limitativo, in cui:

- la figura 1 è un grafico che rappresenta la riflettanza (curva CR) e l'emissività (curva CE) del tungsteno a temperatura ambiente per diverse lunghezze d'onda nello spettro visibile e vicino infrarosso.
- la figura 2 è un grafico che mette a confronto la curva di Planck a 2800K (curva CP) con la potenza spettrale emessa da un filamento di tungsteno a 2800K; per il tungsteno, il grafico riporta sia i valori misurati sperimentalmente (curva PM), sia i valori calcolati utilizzando le costanti ottiche del tungsteno a temperatura ambiente (curva PC);
- le figure 3 e 4 sono rappresentazioni schematiche in sezione di una porzione di emettitore secondo l'invenzione dotato. rispettivamente, di un rivestimento monostrato in ossido di ittrio e di un rivestimento multistrato, ossia presentante un'alternanza di strati dielettrici o semiconduttori;
- la figura 5 è un grafico che rappresenta l'emissività spettrale ad angolo di incidenza 0° a

temperatura ambiente per un emettitore di tungsteno rivestito secondo l'invenzione da uno strato di ossido di ittrio o ittria (curva ER), confrontata con l'emissività spettrale di un emettitore in tungsteno semplice nelle stesse condizioni di temperatura e angolo di incidenza (curva ET);

- la figura 6 è un grafico che mostra la potenza spettrale emessa ad angolo di incidenza 0° da un emettitore di tungsteno a 2000K rivestito secondo l'invenzione da uno strato di 50 nm di ittria (curva PR), confrontata con la curva di Planck (curva CP) e con la potenza spettrale emessa da un emettitore di tungsteno semplice nelle stesse condizioni di temperatura e angolo di incidenza (curva PT);
- la figura 7 è un grafico che rappresenta l'emissività spettrale ad angolo di incidenza 60° a temperatura ambiente per un emettitore di tungsteno rivestito secondo l'invenzione da uno strato di 55 nm di ossido di ittrio o ittria (curva ER), confrontata l'emissività spettrale di un emettitore in tungsteno semplice nelle stesse condizioni di temperatura e angolo di incidenza (curva ET);
- la figura 8 è un grafico che mostra la potenza spettrale emessa ad angolo di incidenza 60° da un emettitore di tungsteno rivestito secondo

l'invenzione da uno strato di 55 nm di ittria a 2000K (curva PR), confrontata con la curva di Planck (curva e con la potenza spettrale emessa da un emettitore di tungsteno semplice nelle stesse condizioni di temperatura e angolo di incidenza (curva PT);

- figura 9 è un grafico che rappresenta l'emissività spettrale ad angolo di incidenza 75° a temperatura ambiente per un emettitore di tungsteno rivestito secondo l'invenzione da uno strato di 60 nm di ossido di ittrio o ittria (curva ER), confrontata l'emissività spettrale di emettitore di un tungsteno semplice nelle stesse condizioni di temperatura e angolo di incidenza (curva ET);
- la figura 10 è un grafico che mostra la potenza spettrale emessa ad angolo di incidenza 75° da un emettitore di tungsteno rivestito l'invenzione da uno strato di 60 nm di ittria a 2000K (curva PR), confrontata con la curva di Planck (curva CP) la con potenza spettrale emessa emettitore di tungsteno semplice nelle stesse condizioni di temperatura e angolo di incidenza (curva PT);
- la figura 11 è una rappresentazione schematica in prospettiva di una porzione di un emetttitore

dotato superficialmente, secondo l'invenzione, di un reticolo di diffrazione unidimensionale, ovvero con rilievi periodici lungo una sola direzione;

- figure 12 е 13 sono rappresentazioni schematiche in prospettiva di rispettive porzioni di due emettitori secondo l'invenzione, dotati superficialmente di un rispettivo reticolo diffrazione bidimensionale, rilevì ovvero con periodici lungo due direzioni ortogonali superficie dell'emettitore;
- la figura 14 è un grafico che mostra riflettanza spettrale calcolata а temperatura ambiente per un filamento di tungsteno a superficie piana (curva RTc), la riflettanza spettrale misurata a temperatura ambiente per una lamina di tungsteno piana (curva RTm), la riflettanza spettrale calcolata filamento di tungsteno microstrutturato secondo l'invenzione con un reticolo unidimensionale (curva RM1) e quella di un filamento di tungsteno microstrutturato secondo l'invenzione con un reticolo bidimensionale (curva RM2); tutte le curve sono per angolo di incidenza di 0°.
- la figura 15 un grafico che mostra l'andamento della riflettanza a lunghezza d'onda di 550 nm in funzione dell'angolo di incidenza; le diverse curve

si riferiscono a riflettanza calcolata per un filamento di tungsteno a superficie piana (curva RT), riflettanza calcolata per un filamento di tungsteno microstrutturato secondo l'invenzione con reticolo bidimensionale (curva RM2), riflettanza calcolata per un filamento di tungsteno microstrutturato secondo l'invenzione con reticolo unidimensionale (curva RM1) per piano di vibrazione perpendicolare alle rigature del reticolo e infine riflettanza calcolata per un filamento di tungsteno microstrutturato con reticolo unidimensionale (curva RM1') per piano di vibrazione parallelo alle rigature del reticolo (90°);

- le figure 16, 17, 18, 19, 20 sono grafici che mostrano l'andamento della riflettanza (curva RM1) in funzione della lunghezza d'onda di un filamento dotato secondo l'invenzione di un reticolo unidimensionale di tungsteno, con passo 0.275 micron, profondità dei rilievi 0.3 micron e fattore riempimento (ovvero rapporto tra larghezza rilievi e periodo del reticolo) pari a 19%; le figure si riferiscono rispettivamente ad angolo di incidenza 0°, 50°, 60°, 70°, e 80° a temperatura ambiente; in ciascuna figura è riportata la riflettanza spettrale di un filamento in tungsteno piano (curva RT) in pari condizioni di temperatura e angolo di incidenza, per

## confronto;

- la figura 21 è un grafico che mostra la variazione percentuale di emissività spettrale del reticolo unidimensionale delle figure 14-18 per angolo di emissione 0°, rispetto al filamento in tungsteno piano;
- la figura 22 è un grafico che mostra la variazione percentuale di emissività spettrale dello stesso reticolo unidimensionale delle figure 14-18 per angolo di emissione 80° rispetto al filamento in tungsteno piano;
- la figura 23 è una rappresentazione schematica che mostra una possibile soluzione per aumentare l'angolo di emissione effettivo in un emettitore dotato di superficie microstrutturata antiriflesso secondo l'invenzione;
- la figura 24 è una rappresentazione schematica in sezione di una porzione di un emettitore secondo l'invenzione, con superficie microstrutturata ricoperta con uno strato di ossido;
- la figura 25 è un grafico che mostra la curva di assorbanza spettrale di uno strato di silicio cristallino di spessore pari a 20 micron, a temperatura ambiente;
  - la figura 26 è un grafico che mostra le curve

di trasmittanza, riflettanza ed emissività spettrale (rispettivamente curve TF, RF e EF) di un emettitore dotato, secondo l'invenzione, di un film di rivestimento di 5 micron di carbonio amorfo ( $\alpha$ -C:H) con 25% di idrogeno a temperatura ambiente;

- figura 27 è un grafico che mostra confronto tra lo spettro di emissione di un corpo nero, o curva di Planck, a 2000K (curva CP) con lo spettro di emissione di เมท materiale avente caratteristiche ottiche a 2000K eguali a quelle del carbonio amorfo idrogenato (curva PCA) con angolo di incidenza 0°, e con lo spettro di un filamento in (curva PT) nelle stesse condizioni tungsteno temperatura e angolo di incidenza;
- la figura 28 è un grafico che mostra l'emissività spettrale del carbonio amorfo idrogenato a temperatura ambiente (curva ECA) e l'emissività spettrale della grafite a temperatura ambiente (EG);
- la figura 29 è un grafico che rappresenta l'andamento dell'energia di bandgap  $(E_g)$  in funzione della temperatura per germanio (curva Ge), silicio (curva Si), arseniuro di gallio (curva GaAs) e carburo di silicio (curva SiC);
- la figura 30 è un grafico che mostra l'emissività spettrale di uno strato di carburo di



silicio a temperatura ambiente (curva ESiC) ed un ipotetico andamento dell'emissività spettrale del carburo di silicio a 2000K (curva ECSiC);

- la figura 31 è un grafico che mostra l'andamento della concentrazione intrinseca di portatori in funzione della temperatura per germanio (curva Ge), silicio (Curva Si), arseniuro di gallio (curva GaAs) e carburo di silicio (curva SiC);
- la figura 32 è una rappresentazione schematica in sezione di una porzione di un emettitore secondo l'invenzione, costituito da uno strato di materiale semiconduttore ad alta temperatura rivestito con uno strato antiriflesso in ossido refrattario;
- la figura 33 è un grafico che mostra a confronto l'emissività spettrale di un emettitore in carburo di silicio rivestito, secondo l'invenzione, da uno strato di ossido di ittrio (curva ESiCR) con quella di un emettitore di carburo di silicio di uguale spessore (curva ESiC).

In una prima possibile forma di attuazione, la caratteristica di assorbimento spettrale del filamento o emettitore secondo l'invenzione è ottenuta attraverso l'utilizzo di un materiale conduttore, ad esempio un metallo, opaco sia nel visibile sia nell'infrarosso ( $\tau$ =0), e rivestendo tale

conduttore con mezzi anti-riflesso operanti per ridurre la riflettanza  $\rho$  nella regione visibile dello spettro, pur mantenendo elevata la riflettanza  $\rho$  nel vicino infrarosso (al di sopra di 0.78 micron di lunghezza d'onda).

I suddetti mezzi anti-riflesso possono essere ad esempio rivestimenti dielettrici monostrato multistrato; la figura 3 mostra a tale scopo una porzione di un emettitore o filamento F in tungsteno dotato, secondo l'invenzione, di un rivestimento in ossido di ittrio RO, mentre la figura 4 illustra una porzione di un emettitore F in tungsteno dotato, secondo l'invenzione, di un rivestimento multistrato, presentante ossia un'alternanza di strati dielettrici o semiconduttori a diverso indice rifrazione, in cui la combinazione dello spessore e dell'indice di rifrazione dei materiali costituenti i diversi strati RP è tale da massimizzare riflettanza nella regione infrarossa dello spettro e minimizzare la riflettanza nella regione visibile dello spettro.

Le figure 5, 7 e 9 mostrano invece l'emissività spettrale a diversi angoli di un emettitore di tungsteno F rivestito da uno strato RO di ossido di ittrio o (ittria), rappresentata dalle curve ER,

confrontata con quella del tungsteno semplice, rappresentata dalle curve ET.

Come visibile ad esempio in figura 5, la presenza di uno strato di 50 nm di ittria consente di aumentare significativamente l'emissività nella regione del visibile (da 0.5 a 0.95 per lunghezza d'onda di 500 nm) а fronte di un aumento indesiderato, anche se molto più esiquo, nell'infrarosso vicino (da 0.3 a 0.4 per lunghezza d'onda di 1.5 micron). Il vantaggio è ancora più significativo a grandi angoli di emissione, come evidente ad esempio in figura 7; in particolare, a 60° rispetto alla normale, uno strato di ittria di spessore 55 nm porta ad un incremento di emissività nell'infrarosso vicino più esiguo (da 0.32 a 0.36 per lunghezza d'onda di 1.5 micron). Ad angoli ancora maggiori, l'emissività nell'infrarosso vicino diminuisce a fronte di un aumento nello spettro visibile; questo è chiaramente visibile in figura 9, dove confrontano si l'emissività spettrale del tungsteno 75° (curva ET) con l'emissività spettrale, sempre a 75°, di un filamento di tungsteno rivestito da 60 nanometri di ittria (curva ER).

Moltiplicando le emissività spettrali delle figure 5, 7 e 9 per la curva di Planck a 2000K si

ottengono le potenze spettrali emesse, rappresentate nelle figure 6, 8 e 10; l'operazione richiederebbe l'utilizzo di costanti ottiche per il tungsteno e per l'ittria relative alla temperatura di 2000K, ma la differenza rispetto alle costanti ottiche a temperatura T ambiente, per quanto significativa, non è rilevante ai fini della presente esposizione.

La presenza dello strato RO di ittria porta ad un incremento relativo di efficienza, definita come rapporto tra potenza la emessa nell'intervallo spettrale 0.38-0.78 micron е la potenza emessa nell'intervallo spettrale 0.3-3 micron, pari a 25%, 22% e 26% rispettivamente per angolo di emissione 0°, 60° e 75°.

Aumenti efficienza di più significativi si possono teoricamente ottenere utilizzando un rivestimento antiriflesso multistrato, sono praticamente limitati dalla scarsa varietà di indici di rifrazione in materiali refrattari, da utilizzare come strati di tale rivestimento.

Il valore di efficienza finale ottenuto con il rivestimento monostrato di ittria RO per emissione a 0° è pari a 6.5% equivalente a quanto ottenibile semplicemente aumentando la temperatura del filamento di tungsteno, in assenza di rivestimento, di circa



100K.

In una seconda possibile implementazione della presente invenzione, l'incremento di efficienza di emissione visibile è ottenuto attraverso opportuna microstrutturazione della superficie dell'emettitore 0 filamento per la lampada incandescenza.

Il comportamento antiriflesso desiderato si può ottenere sia con un reticolo unidimensionale, ossia con rilievi periodici lungo una sola direzione sulla superficie del filamento, sia con un reticolo di diffrazione bidimensionale, ossia con rilevi periodici lungo due direzioni ortogonali sulla superficie del filamento. A tale scopo, in figura 11. con F viene indicata una porzione di un emettitore secondo l'invenzione, il quale presenta superficialmente un reticolo di diffrazione R formato microrilievi R1 periodici lungo direzione; nel caso rappresentato nelle figure 12 e 13, invece, la porzione F di emettitore secondo l'invenzione presenta superficialmente un reticolo di diffrazione R formato da microrilievi R2 periodici lungo due direzioni ortogonali. Nelle figure 11-13, con h è indicata la profondità o altezza dei rilievi R1, R2, con D la larghezza dei rilievi e con P il

periodo del reticolo R; il fattore di riempimento del reticolo R è definito come rapporto D/P nel caso di figura 11, come rapporto  $D^2/P^2$  nel caso di figura 12 e come rapporto  $\pi D^2/(4P^2)$  nel caso di figura 13.

Ilvantaggio del reticolo R formato dai microrilievi R1, R2 rispetto ai rivestimenti antiriflesso multi-strato sta nel fatto che possibile portare ilfilamento а temperature maggiori, ad esempio 2500K, senza essere limitati dalla temperatura di fusione degli ossidi utilizzati come strati del rivestimento.

In figura 14, la curva RTc rappresenta la riflettanza spettrale calcolata а temperatura ambiente per un filamento di tungsteno a superficie piana, la curva RTm rappresenta la riflettanza spettrale misurata a temperatura ambiente per una lamina di tungsteno piana, la curva RM1 rappresenta la riflettanza spettrale calcolata per un filamento tungsteno microstrutturato con un reticolo R unidimensionale (del tipo rappresentato in figura 11, con parametri D/P=0.15, h=0.3 micron, P=0.25 micron) e la curva RM2 rappresenta la riflettanza spettrale calcolata di un filamento di tungsteno microstrutturato con un reticolo R bidimensionale (del tipo rappresentato in figura 12, con parametri

 $D^2/P^2=0.15$ , h=0.1 micron, P=0.25 micron). I dati di figura 14 si riferiscono a temperatura ambiente e ad un angolo di incidenza pari a 0°.

Dalla figura 14 è immediato rilevare il diverso andamento della riflettanza tra filamenti piani in tungsteno e filamenti strutturati secondo l'invenzione. La figura 15 mostra invece l'andamento della riflettanza a lunghezza d'onda di 550 nm in funzione dell'angolo di incidenza; in particolare:

- la curva curva RT si riferisce alla riflettanza calcolata per un tradizionale filamento di tungsteno a superficie piana,
- la curva RM2 si riferisce alla riflettanza calcolata per un primo filamento di tungsteno secondo l'invenzione, microstrutturato con reticolo R bidimensionale (del tipo rappresentato in figura 12, con parametri  $D^2/P^2=0.15$ , h=0.1 micron, P=0.25 micron),
- la curva RM1 si riferisce alla riflettanza calcolata per un secondo filamento di tungsteno secondo l'invenzione, microstrutturato con reticolo R unidimensionale (del tipo rappresentato in figura 11, con parametri D/P=0.15, h=0.3 micron, P=0.25 micron), per piano di vibrazione perpendicolare alle rigature R1 del reticolo, e

- la curva RM1' si riferisce alla riflettanza calcolata per il filamento di tungsteno microstrutturato con reticolo R unidimensionale, mare per piano di vibrazione parallelo alle rigature R1 del reticolo (90°).

Anche dalla figura 15 è immediato rilevare il diverso andamento della riflettanza tra filamenti piani in tungsteno e filamenti strutturati secondo l'invenzione. Come evidente, la strutturazione superficiale del tungsteno che realizza l'emettitore consente di abbassare in modo significativo il valore di riflettanza nel visibile a fronte di una riduzione di riflettanza decisamente inferiore nell'infrarosso vicino.

In realtà, per capire l'entità dell'aumento di efficienza occorre considerare le curve di variazione percentuale dell'emissività spettrale; si ha un effettivo miglioramento dell'efficienza soltanto nel caso in cui la variazione relativa di emissività nel visibile è maggiore della variazione relativa di emissività nell'infrarosso vicino.

Un risultato interessante, presentato per la prima volta dalla presente invenzione, è il fatto che le caratteristiche antiriflesso del reticolo R unidimensionale si mantengono anche quando il piano

di vibrazione è parallelo alle rigature del reticolo (curva RM1' di figura 15).

Le figure 16, 17, 18, 19, 20 mostrano l'andamento della curva RM1 di riflettanza in funzione della lunghezza d'onda per un reticolo R unidimensionale di tungsteno secondo l'invenzione, con passo micron, profondità h dei rilievi 0.3 micron e fattore di riempimento D/P (ovvero rapporto tra larghezza dei rilievi e periodo del reticolo) pari a 19%. particolare le figure si riferiscono rispettivamente ad angoli di incidenza di 0°, 50°, 60°, 70°, e 80°; in ciascuna figura è riportata la curva RT riflettanza spettrale del tungsteno piano, per confronto.

Si osservi come, al di sopra dei riflettanza del reticolo R nell'infrarosso vicino inferiore a quella del tungsteno piano; diventa questo comporta un aumento di efficienza nel visibile è superiore al caso di incidenza normale. Moltiplicando le emissività relative аi diversi angoli (ottenute come opposto della riflettanza) per la curva di Planck a 2500K si ottiene una variazione di efficienza rispettivamente del -2%, +10%, +23%, +48% e +90%. La riduzione di efficienza nel caso di angolo di emissione 0° è dovuta al fatto che,

nonostante 1'aumento di emissività in termini assoluti sia molto superiore nella parte visibile che nella parte infrarossa dello spettro, la variazione relativa è superiore nell'infrarosso (come evidente in figura 21). E' altresì evidente come l'aumento di efficienza sia particolarmente · significativo grandi angoli; mediamente tra 50° e 80° l'efficienza aumenta del 35%. L'efficienza quasi raddoppia a 80°, grazie alla forte diminuzione relativa dell'emissività spettrale nell'infrarosso (si figura 22).

Questo suggerisce quindi la possibilità di realizzare una sorgente ad incandescenza, in cui la forma macroscopica dell'emettitore è caratterizzata da un corrugamento finalizzato ad aumentare l'angolo medio di emissione rispetto alla direzione normale alla superficie dell'emettitore, mentre un reticolo antiriflesso microscopico sulla superficie dell'emettitore permette di incrementare l'efficienza di emissione a grande angolo; un esempio di questa forma di attuazione dell'invenzione è rappresentato in figura 23, ove con MA è indicata la superficie dell'emettitore dotato di microstruttura antiriflesso.

La corrugazione non modifica il lobo di emissione

rispetto al piano  $\kappa$ , che rimane sostanzialmente lambertiano, ma fa sì che la radiazione emessa nel cono  $[-\gamma, +\gamma]$  rispetto alla direzione normale al piano κ, sia in realtà emessa con un angolo rispetto alla direzione normale alla superficie dell'emettitore (o angolo di emissione effettivo) compreso nell'intervallo  $[\beta-\gamma,\beta+\gamma]$ . Essendo il lobo di emissione lambertiano, il massimo di intensità si ha corrispondenza di  $\gamma=0$ , che corrisponde ad angolo di emissione effettivo pari a eta. Per ogni  $\gamma$  compreso nell'intervallo  $[-90+\beta, 90-\beta]$  in generale si hanno due angoli di emissione effettivi,  $\beta+\gamma$  e  $\beta-\gamma$ . Per  $\gamma>90-\beta$ l'angolo di emissione effettivo è  $\beta$ - $\gamma$ , mentre per  $\gamma < -90+\beta$  l'angolo di emissione effettivo è β+γ. esempio per  $\beta=60^{\circ}$ , e  $\gamma=40^{\circ}$  si ha un angolo di emissione effettivo pari a 20°, mentre per  $\gamma=20°$  si hanno due angoli di emissione effettivi, uno a 40° ed uno a 80°. Il concetto è rappresentato in figura 23 nel caso bidimensionale, ma può essere facilmente trasferito al caso tridimensionale.

In generale il reticolo antiriflesso previsto secondo l'invenzione può anche essere multilivello o a profilo continuo, il che consente di aumentare i gradi di libertà per l'ottimizzazione del reticolo ed incrementare ulteriormente l'efficienza.

In accordo ad un'ulteriore configurazione, reticolo di diffrazione può essere rivestito con uno o più strati di ossido refrattario, ad esempio ossido di ittrio, al fine di incrementare ulteriormente i gradi di libertà nell'ottimizzazione dell'efficienza. Un tale caso viene rappresentato schematicamente in figura 24, ove con F viene indicato un filamento dotato del reticolo di diffrazione formato da rilievi R1, il reticolo essendo ricoperto da uno strato di ossido RO. Inoltre, la presenza di un rivestimento di ossido può consentire di operare il filamento condizioni di vuoto meno spinto o, in linea di principio, anche in aria senza andare incontro a fenomeni di ossidazione del filamento; in ogni caso, sia in condizioni di vuoto che in atmosfera di gas inerte, la presenza del rivestimento di consente di ridurre il tasso di evaporazione del tungsteno e quindi aumentare la vita media della sorgente.

Un'ulteriore possibile implementazione della presente invenzione consiste nel realizzare l'emettitore con un sottile strato di materiale semiconduttore, avente bassa riflettanza  $\rho$  sia nel visibile sia nell'infrarosso, alta trasmittanza  $\tau$  nell'infrarosso vicino e bassa trasmittanza  $\tau$  nel



visibile. Questa caratteristica a T ambiente è tipica ad esempio del silicio o di altri semiconduttori avente bandgap E<sub>g</sub> di valore prossimo alle transizioni visibili (1.6-3.2eV); infatti, su spessori sufficientemente sottili, un semiconduttore tende a trasmettere le lunghezze d'onda più lunghe, associate energia dei fotoni inferiore all'energia bandgap  $E_g$ . Ad esempio, il silicio cristallino ha una bandgap  $E_g$  a temperatura ambiente di 1.1eV e tende per questo a trasmettere fotoni di energia inferiore a 1.1eV, ossia di lunghezza d'onda superiore ad 1.13 micron, definita dalla relazione  $\lambda_g=1.2469/E_q$ .

Nel caso del silicio, i fotoni di energia molto superiore alla bandgap vengono riflessi, risulta in un assorbanza spettrale alta nel visibile e bassa sia nell'infrarosso sia nell'ultravioletto; a tale scopo, la figura 25 rappresenta la curva di assorbanza spettrale di uno strato di silicio cristallino di spessore 20 micron; questa ragione per cui il silicio è sempre storicamente utilizzato come rivelatore di radiazione visibile, nei sensori CCD, o come materiale per celle fotovoltaiche.

Si osservi che se il silicio fosse in grado di sostenere le alte temperature di un filamento ad

incandescenza e mantenesse le sue caratteristiche ottiche a tali temperature, sarebbe un emettitore quasi ideale, grazie alla discontinuità netta nella sua assorbanza spettrale in corrispondenza di 1.1 micron. A titolo speculativo, un materiale avente una simile curva di assorbanza spettrale avrebbe a 2000K un efficienza radiativa nel visibile superiore al 30%.

Un altro materiale con caratteristiche ottiche simili al silicio è il carbonio amorfo idrogenato  $\alpha$ -C:H, tipicamente utilizzato nei rivestimenti indurenti noti come "diamond-likecarbon" o DLC. L' $\alpha$ -C:H ha costanti ottiche che variano grandemente sulla base della percentuale di idrogeno; la figura 26 rappresenta le curve trasmittanza TF, riflettanza RF ed emissività spettrale di un film di 5 micron di  $\alpha$ -C:H con 25% di idrogeno a temperatura ambiente; si può osservare che, come il silicio, il film di  $\alpha-\text{C}:\text{H}$  presenta un'elevata trasmittanza nell'infrarosso vicino ed un alto assorbimento nel visibile, il che lo renderebbe di nuovo un emettitore quasi ideale. Le oscillazioni nelle curve di riflettanza e trasmittanza sono dovute a fenomeni di interferenza tra le onde riflesse dalla prima e dalla seconda interfaccia del film;

frequenza di tali oscillazioni tende a crescere al crescere dello spessore dello strato.

La figura 27 confronta la curva di Planck CP, ossia lo spettro di emissione di un corpo nero, a 2000K con lo spettro di emissione di un filamento di un materiale avente caratteristiche ottiche a 2000K eguali a quelle del carbonio amorfo idrogenato (curva PCA) e con un filamento in tungsteno (curva PT); l'efficienza di tale ipotetico materiale sarebbe del 14%, contro il 5% del tungsteno.

Il carbonio, contrariamente al silicio, ha un punto di fusione molto alto ed è quindi in grado di raggiungere temperature di incandescenza; purtroppo, però, a temperature di poche centinaia di gradi l'α-C:H grafitizza е le sue costanti ottiche diventano quelle della grafite, che presenta purtroppo un alto valore di assorbimento nell'infrarosso; tale fatto è visibile in figura 28, ove sono messe a confronto l'emissività spettrale del amorfo idrogenato carbonio (curva ECA) della grafite (curva EG).

Com'è noto, la temperatura ha un'influenza significativa sulle costanti ottiche dei materiali; nel caso di materiali semiconduttori, gli effetti principali di un incremento di temperatura sono la

diminuzione dell'energia di bandgap  $E_g$  e l'aumento della concentrazione di elettroni in banda conduzione e di lacune in banda di valenza, dovuto all'aumento di energia termica dei portatori carica. La figura 29 rappresenta l'andamento di  $E_{\text{g}}$  in funzione della temperatura per germanio (curva Ge), silicio (curva Si), arseniuro di gallio (curva GaAs) silicio (curva SiC); l'andamento è carburo di pressappoco lineare, con pendenza di poco dipendente dal valore di bandgap a temperatura ambiente. Dal punto di vista dell'assorbimento, l'abbassamento della bandgap porta ad uno spostamento dello spettro verso le lunghezze d'onda maggiori; ad esempio, a 1000K la bandgap del silicio è circa di 0.9eV, il che significa che il silicio a 1000K può assorbire radiazione di lunghezza d'onda fino  $\lambda_{g}=1.2469/E_{g}=1.39$ micron е per spessori sufficientemente sottili trasmetterà la radiazione di lunghezza d'onda superiore a  $\lambda_{\alpha}$ . La dell'arseniuro di gallio a 1000K si porta invece da 1.4eV (temperatura ambiente) a 1.1eV ed è quindi lecito attendersi uno spettro di assorbimento simile, ovviamente non in termini assoluti, a quello del silicio a temperatura ambiente.

Particolarmente interessante a questo proposito è



il carburo di silicio, o SiC, grazie al valore elevato della temperatura di fusione che lo rende un materiale potenzialmente utilizzabile in sorgenti ad incandescenza. Il SiC ha una bandbap a temperatura ambiente intorno a 3.2eV, il che fa sì che per spessori sufficientemente sottili il materiale trasmetta al di sopra di  $\lambda_g=1.2469/E_g=386$  nm.

La bandgap si riduce significativamente crescere della temperatura portando il valore di  $\lambda_g$ =1.2469/E $_g$  a 2000K intorno 540 nm. Questo garantirebbe una emissione efficace di radiazione nel visibile fino a 540 nm ed una emissione molto bassa nello spettro rosso/infrarosso. Questa situazione è rappresentata in figura 30, dove è riportata l'emissività spettrale di uno strato di 20 micron di carburo di silicio (curva EsiC) a temperatura ambiente ed un ipotetico spostamento della curva al crescere della temperatura verso le lunghezze d'onda maggiori (curva ECSiC).

Ovviamente i valori di assorbanza spettrale sono anche influenzati dalla variazione della concentrazione intrinseca di portatori e dalle modificazioni della struttura cristallina. In generale, al crescere della temperatura cresce la concentrazione di portatori liberi e aumenta quindi

l'assorbimento. Tale aumento interessa anche la regione spettrale dell'infrarosso, con conseguente riduzione di efficienza dell'emettitore. Tuttavia, se lo spessore dello strato è sufficientemente piccolo, l'assorbimento nel vicino infrarosso rimane basso e l'emettitore mantiene alta efficienza.

La figura 31 mostra l'andamento della concentrazione intrinseca di portatori in funzione della temperatura per germanio (curva Ge), silicio (curva Si), arseniuro di gallio (curva GaAs) e carburo di silicio (curva SiC); come evidente, la concentrazione decresce esponenzialmente al crescere del rapporto 1/T. Come evidente dal grafico, la concentrazione intrinseca (in cm<sup>-3</sup>) nel SiC a 2000K è dell'ordine di 10<sup>16</sup>, valore tipico di un silicio debolmente drogato.

In un'ulteriore configurazione secondo l'invenzione, schematizzata in figura caratteristiche relative alle due configurazioni precedentemente menzionate sono combinate in modo da realizzare un emettitore F costituito da uno strato di materiale semiconduttore ad alta temperatura, quale il carburo di silicio, avente elevata trasmittanza nell'infrarosso vicino assorbanza nel visibile, rivestito con uno strato

antiriflesso RO, ad esempio un singolo strato di ossido refrattario, tale da massimizzare l'assorbimento dell'emettitore nel visibile senza incrementare l'assorbimento nell'infrarosso vicino.

A titolo di esempio, questo si può ottenere rivestendo uno strato di 20 micron di SiC (che realizza l'emettitore F, con uno strato RO di 20 nm ittria; la figura 33 mette a confronto l'emissività spettrale di un siffatto emettitore (curva EsiCR) con quella di un emettitore di solo carburo di silicio di uguale spessore (Curva EsiC). In alternativa, il comportamento antiriflesso nel visibile óuq essere ottenuto attraverso una microstrutturazione superficiale del semiconduttore, secondo una qualsiasi delle tecniche precedentemente esposte con riferimento alle figure 11-13.

Da quanto sopra descritto risulta pertanto chiaro come, nelle varie possibili implementazioni dell'invenzione, definita  $\alpha(\lambda,T)$  l'assorbanza spettrale dell'emettitore alla temperatura operativa T, quale assorbanza è legata alla riflettanza spettrale  $\rho(\lambda,T)$  ed alla trasmittanza spettrale  $\tau(\lambda,T)$  dalla relazione  $\alpha(\lambda) = 1 - \rho(\lambda, T) - \tau(\lambda, T),$ la composizione struttura dell'emettitore secondo l'invenzione possono essere ottimizzate in modo da minimizzare  $\alpha(\lambda)$ 

per  $\lambda$  appartenente alla regione visibile dello spettro e massimizzare  $\alpha(\lambda)$  per  $\lambda$  appartenente alla regione infrarossa dello spettro.

In tal modo, a parità di temperatura operativa T, il rapporto tra la radiazione emessa nella regione visibile dello spettro e la radiazione emessa nella regione infrarossa dello spettro per un emettitore secondo l'invenzione risulta maggiore dello stesso rapporto rispetto al caso di un filamento ad incandescenza tradizionale, con evidenti vantaggi in termini di efficienza della sorgente di luce.

Come evidenziato, i mezzi che consentono di raggiungere gli scopi preposti sono costituiti strutturazioni superficiali dell'emettitore, oppure da particolari materiali, aventi un'elevata trasmittanza  $au(\lambda,T)$  alla radiazione infrarossa ed un'elevata assorbanza  $\alpha(\lambda,T)$  nella regione visibile spettro; detti materiali sono utilizzabili dello anche in combinazione, in modo tale per l'emettitore presenti un'elevata trasmittanza  $\tau(\lambda,T)$ alla radiazione infrarossa ed un'elevata assorbanza  $\alpha(\lambda,T)$  nella regione visibile dello spettro.

Naturalmente, fermo restando il principio del trovato, i particolari di costruzione e le forme di attuazione potranno ampiamente variare rispetto a



quanto descritto ed illustrato a puro titolo di esempio, senza per questo uscire dall'ambito della presente invenzione.

Nelle varie implementazioni, l'ossido di ittrio potrebbe essere sostituito dall'ossido di un metallo appartenente al gruppo delle terre rare.

Il reticolo di diffrazione superficiale dell'emettitore secondo l'invenzione potrebbe essere tridimensionale, ovvero periodico lungo due direzioni sostanzialmente perpendicolari tra loro e contenute nel piano del reticolo e lungo una terza direzione sostanzialmente perpendicolare alla superficie del reticolo. sopra accennato, il Come reticolo diffrazione potrebbe essere multilivello, ad esempio a due o più livelli o avere un rilievo variabile in modo continuo all'interno del periodo.

I mezzi antiriflesso potrebbero essere in forma di reticolo di diffrazione di volume, avente una configurazione simile a quella visibile in figura 24, con una superficie esterna sostanzialmente piatta ed una modulazione periodica dell'indice di rifrazione complesso all'interno del volume dell'emettitore F.

\* \* \* \* \*

## RIVENDICAZIONI

- Emettitore ' 1. di luce per lampade incandescenza, in particolare filamento, un suscettibile di essere portato· all'incandescenza tramite passaggio di corrente elettrica, l'emettitore avendo una rispettiva assorbanza spettrale  $\alpha(\lambda,T)$  ad una temperatura operativa T e per una lunghezza d'onda l'assorbanza essendo legata alla riflettanza spettrale  $\rho(\lambda,T)$  ed alla trasmittanza spettrale  $\tau(\lambda,T)$  dalla relazione  $\alpha(\lambda)=1-\rho(\lambda,T)-\tau(\lambda,T)$ , caratterizzato dal fatto che sono previsti mezzi (R; RO; RP) per massimizzare l'assorbanza  $\alpha(\lambda)$  per appartenente alla regione visibile dello spettro e minimizzare l'assorbanza  $\alpha(\lambda)$  per  $\lambda$  appartenente alla regione infrarossa dello spettro, in modo tale per cui, a parità di temperatura operativa T, il rapporto tra la radiazione emessa nella regione visibile dello spettro la radiazione emessa nella regione infrarossa dello spettro dell'emettitore sia maggiore rispetto allo stesso rapporto per un filamento ad incandescenza di tipo tradizionale.
- 2. Emettitore secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che è realizzato con uno o più materiali sostanzialmente opachi sia alla

radiazione visibile sia alla radiazione infrarossa, ovvero con trasmittanza  $\tau(\lambda,T)$  sostanzialmente nulla.

- Emettitore secondo la rivendicazione 2, caratterizzato dal fatto che detti mezzi (R; RO; RP) comprendono mezzi antiriflesso (R; RO; RP) operanti sulla riflettanza spettrale  $\rho(\lambda,T)$  dell'emettitore (F), in modo che la variazione relativa di assorbanza  $\alpha(\lambda,T)$ nella regione visibile dello spettro, conseguente all'impiego di detti mezzi antiriflesso, sia maggiore della variazione relativa di assorbanza  $\alpha(\lambda,T)$  nella regione infrarossa dello spettro.
- Emettitore secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che detti mezzi (R; RO; RP) comprendono uno o più materiali (RO, RP) aventi un'elevata trasmittanza  $\tau(\lambda,T)$ alla radiazione infrarossa ed un'elevata assorbanza  $\alpha(\lambda,T)$ regione visibile dello spettro, ove detti materiali sono in particolare in combinazione tale per cui l'emettitore (F) presenti un'elevata trasmittanza  $\tau(\lambda,T)$ alla radiazione infrarossa ed un'elevata assorbanza  $\alpha(\lambda,T)$  nella regione visibile dello spettro.
- 5. Emettitore secondo la rivendicazione 3, caratterizzato dal fatto che detti mezzi antiriflesso comprendono un rivestimento antiriflesso (R; RO; RP)

dell'emettitore (F).

- Emettitore secondo 6. la rivendicazione 5, caratterizzato dal fatto detto rivestimento antiriflesso (R; RO; RP) è del tipo multi-strato (RP), in particolare presentante un'alternanza strati dielettrici o semiconduttori (RP) a diverso indice di rifrazione, in cui la combinazione dello spessore e dell'indice di rifrazione dei materiali costituenti i diversi strati è tale da massimizzare la riflettanza  $\rho(\lambda,T)$  nella regione infrarossa dello spettro e minimizzare la riflettanza  $\rho(\lambda,T)$ regione visibile dello spettro.
- 7. Emettitore secondo la rivendicazione 5, caratterizzato dal fatto che detto rivestimento antiriflesso (R; RO; RP) è costituito da un singolo strato di ossido refrattario (RO).
- 8. Emettitore secondo la rivendicazione 7, caratterizzato dal fatto che detto ossido refrattario è un ossido di ittrio depositato su un sottostrato di tungsteno dell'emettitore (F).
- 9. Emettitore secondo la rivendicazione 7, caratterizzato dal fatto che detto ossido refrattario è l'ossido di un metallo appartenente al gruppo delle terre rare.
  - 10. Emettitore secondo la rivendicazione 3,

caratterizzato dal fatto che detti mezzi antiriflesso (R; RO; RP) comprendono un reticolo di diffrazione a rilievo (R) dell'emettitore (F), comprendente una pluralità di microrilievi (R1, R2), in cui la forma dei microrilievi, lo spessore dei microrilievi ed il periodo del reticolo sono tali da massimizzare la riflettanza  $\rho(\lambda,T)$  nella regione infrarossa dello spettro e minimizzare la riflettanza  $\rho(\lambda,T)$  nella regione visibile dello spettro.

- 11. Emettitore secondo la rivendicazione 10, caratterizzato dal fatto che detto reticolo di diffrazione (R) è unidimensionale, ovvero periodico lungo una sola direzione contenuta nel piano del reticolo.
- 12. Emettitore secondo la rivendicazione 10, caratterizzato dal fatto che detto reticolo di diffrazione (R) è bidimensionale, ovvero periodico lungo due direzioni sostanzialmente perpendicolari tra loro e contenute nel piano del reticolo.
- 13. Emettitore secondo la rivendicazione 10, caratterizzato dal fatto che detto reticolo di diffrazione è tridimensionale, ovvero periodico lungo due direzioni sostanzialmente perpendicolari tra loro e contenute nel piano del reticolo e lungo una terza direzione sostanzialmente perpendicolare alla

superficie del reticolo.

- 14. Emettitore secondo la rivendicazione 10, caratterizzato dal fatto che detto reticolo di diffrazione è binario, ovvero a due livelli.
- 15. Emettitore secondo la rivendicazione 10, caratterizzato dal fatto che detto reticolo di diffrazione ha un rilievo con numero di livelli superiore a due.
- 16. Emettitore secondo la rivendicazione 10, caratterizzato dal fatto che detto reticolo di diffrazione ha un rilievo variabile in modo continuo all'interno del periodo.
- 17. Emettitore secondo la rivendicazione 10, caratterizzato dal fatto che detto reticolo di diffrazione (R) è ricavato attraverso una microstrutturazione superficiale dell'emettitore (F), quest'ultimo essendo in tungsteno.
- 18. Emettitore secondo la rivendicazione 3, caratterizzato dal fatto che detti mezzi antiriflesso comprendono un reticolo di diffrazione di volume, ovvero con una superficie esterna sostanzialmente piatta ed una modulazione periodica dell'indice di rifrazione complesso all'interno del volume dell'emettitore.
  - 19. Emettitore secondo la rivendicazione 4,

caratterizzato dal fatto che almeno uno dei materiali che forma l'emettitore (F) è un materiale semiconduttore resistente ad alte temperature.

- 20. Emettitore secondo la rivendicazione 19, caratterizzato dal fatto detto materiale semiconduttore presenta una banda proibita alla temperatura operativa di energia superiore a 1eV.
- 21. Emettitore secondo la rivendicazione 20, caratterizzato dal fatto detto materiale semiconduttore è carburo di silicio.
- 22. Emettitore secondo la rivendicazione caratterizzato dal fatto che detti mezzi comprendono rivestimento un antiriflesso (R; RO; dell'emettitore (F), operante sulla riflettanza spettrale  $\rho(\lambda,T)$  dell'emettitore, in modo che variazione relativa di assorbanza  $\alpha(\lambda,T)$  nella regione visibile dello spettro sia maggiore della variazione relativa di assorbanza  $\alpha(\lambda,T)$  nella regione infrarossa dello spettro.
- 23. Emettitore secondo la rivendicazione 22, caratterizzato dal fatto che detto rivestimento antiriflesso (R; RO; RP) è un rivestimento multistrato (RP), presentante in particolare un'alternanza di strati dielettrici o semiconduttori (RP) a diverso indice di rifrazione, in cui la combinazione dello

spessore e dell'indice di rifrazione dei materiali costituenti i diversi strati (RP) è tale da minimizzare la riflettanza  $\rho(\lambda,T)$  nella regione visibile dello spettro.

- Emettitore secondo la rivendicazione 24. 22, caratterizzato dal fatto che detto rivestimento antiriflesso (R; RO; RP) comprende un reticolo di diffrazione a rilievo (R) dell'emettitore formato da microrilievi (R1; R2), in cui la forma dei microrilievi, lo spessore dei microrilievi ed il periodo del reticolo sono ottimizzati in modo tale da minimizzare la riflettanza  $ho(\lambda,T)$  nella regione visibile dello spettro.
- Emettitore secondo la rivendicazione 22, 25. caratterizzato dal fatto detto rivestimento che antiriflesso (R; RO; RP) comprende un reticolo di diffrazione di volume, ovvero con una superficie esterna sostanzialmente piatta ed una modulazione periodica dell'indice di rifrazione complesso all'interno del volume dell'emettitore, detto reticolo di diffrazione di volume essendo ottimizzato in modo tale da minimizzare la riflettanza  $\rho(\lambda,T)$ nella regione visibile dello spettro.
- 26. Emettitore secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto

che opera a una temperatura inferiore a 2500K.

- 27. Una sorgente di luce ad incandescenza, comprendente un emettitore di luce (F) suscettibile di essere portato all'incandescenza tramite passaggio di corrente elettrica, caratterizzato al fatto che detto emettitore (F) è realizzato secondo una o più delle precedenti rivendicazioni.
- Il tutto sostanzialmente come descritto ed illustrato e per gli scopi specificati.

Ing. Giancario NOTARO N. ischiz ALBO 258 i in proprio a parigii alini

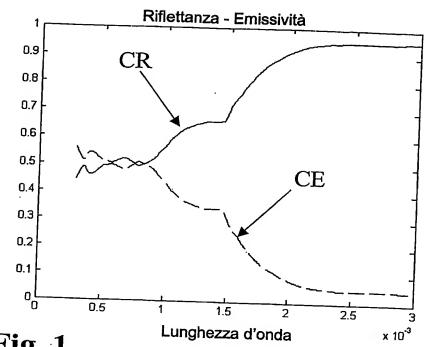


Fig. 1

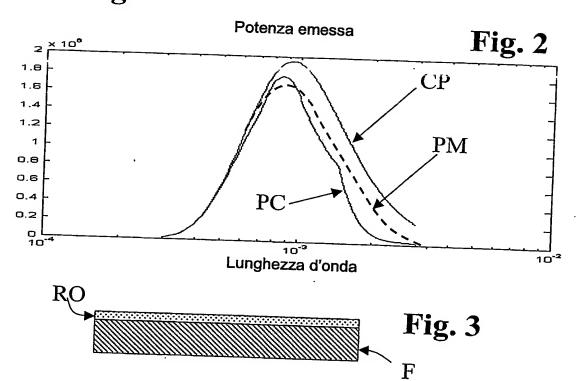


Fig. 4



Ing. Glancarlo NOTARO
N. Istriz ALBO 258
Ila proprio glan gli alini

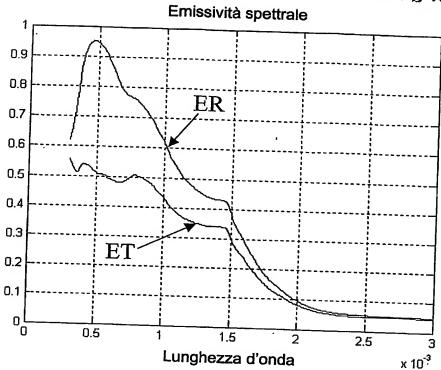


Fig. 5

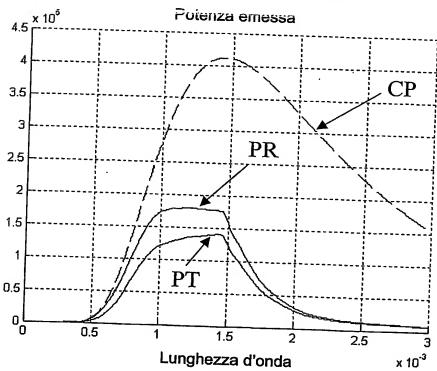
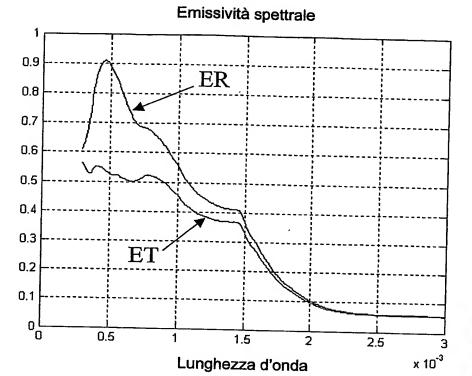


Fig. 6

Ing. Giancarlo NOTARO N. Isérit AMO 258 (In prodrio e per gli altri)



SINIM SINIM

**Fig. 7** 

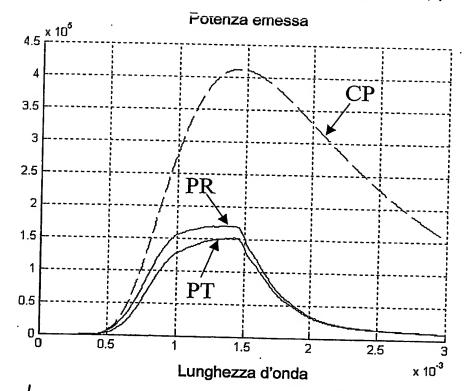


Fig. 8

Ing. Glancofid NOTARO
N. isquis Algo 258
In propride per ali alimi

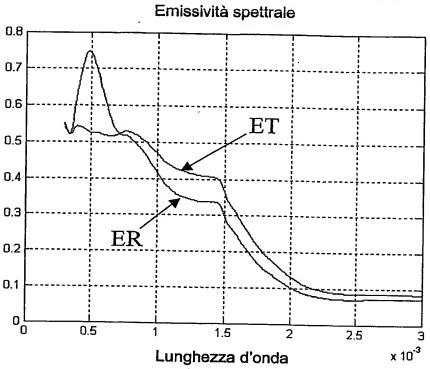


Fig. 9

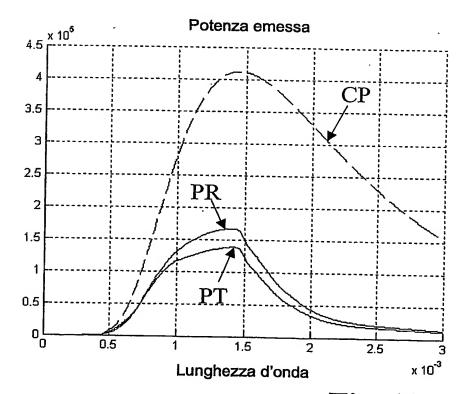
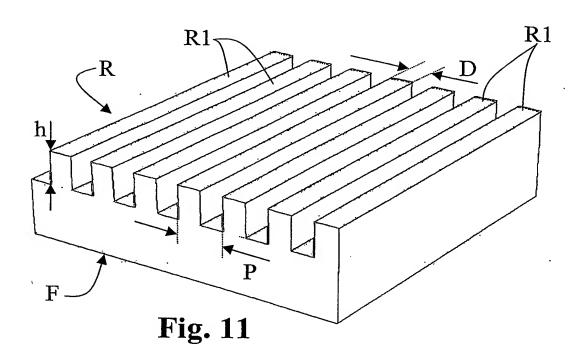
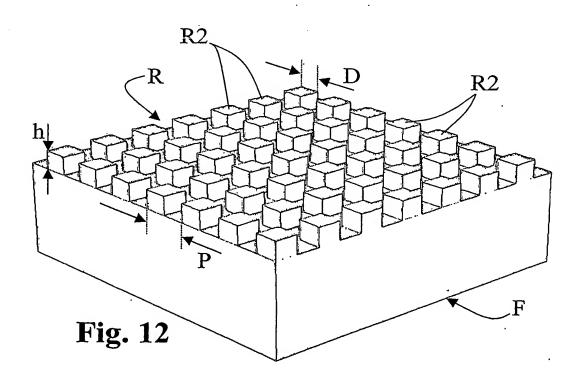


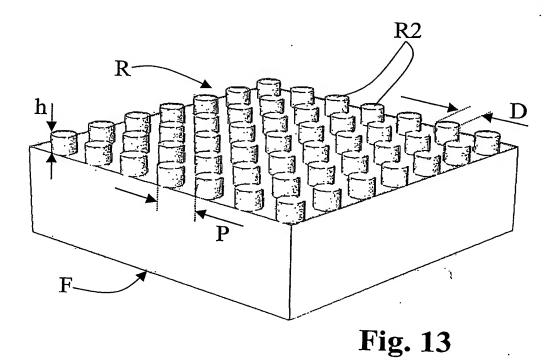
Fig. 10

Ing. Giancoflo, NOTARO
N. Iscriz. ALBO 258
Lin proprio p per gli altri





Ing. Gioncerio NOTARO N. Isdrizi ALBO/258 I la proprio e per ali altri



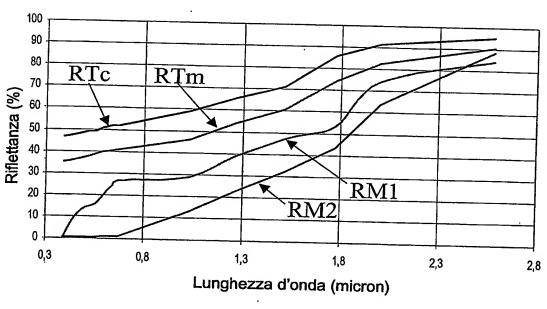


Fig. 14

Ing. Gloncorlo NOTARO
N. Accile. Albo (558
110 pregio o per gli oliri)

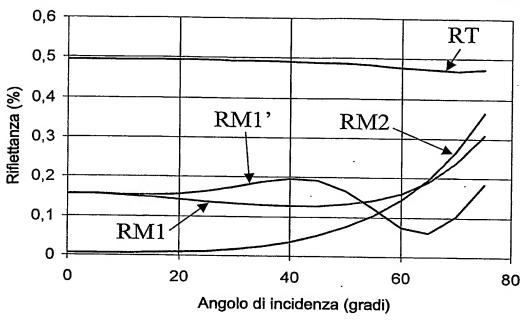
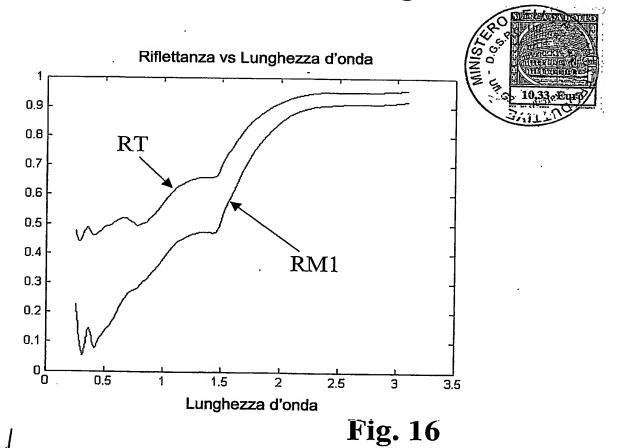


Fig. 15





Ing. Glangarlo MOTARO
N Iszriz Alleto 258
In proprio e per gli aluti

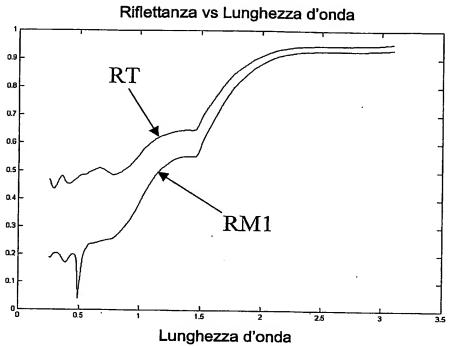


Fig. 17

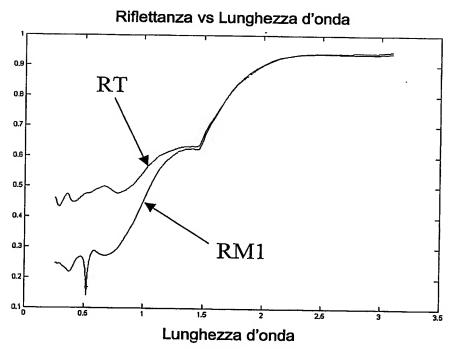


Fig. 18

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

ing. Glendario MOTARC Nilstriz ALBO, 258 Ilin piporio e per gli alirii

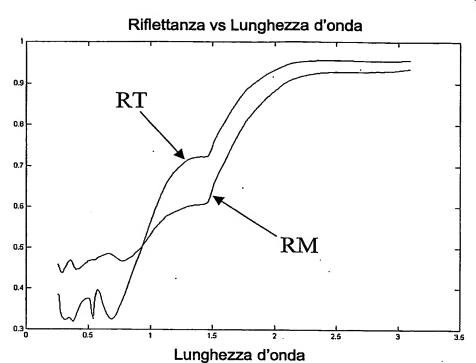


Fig. 19

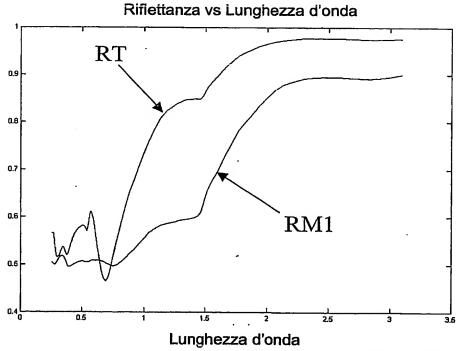


Fig. 20

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOITURA DI TORINO

ing. Giancarlo MOTARO N. Isrfizi ABO 258 I in proprio e per di altri)

Fig. 21

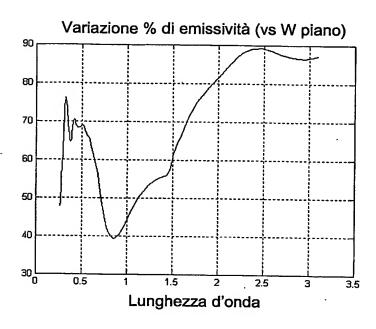
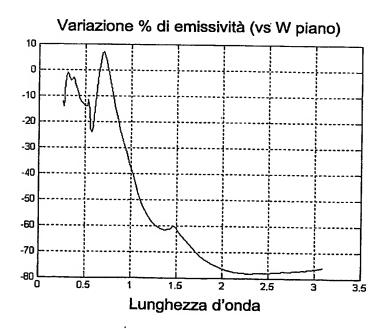


Fig. 22



ing. Glandario IVOTARO N. Iseriz ALEO 258 I in proprio e per gli alini

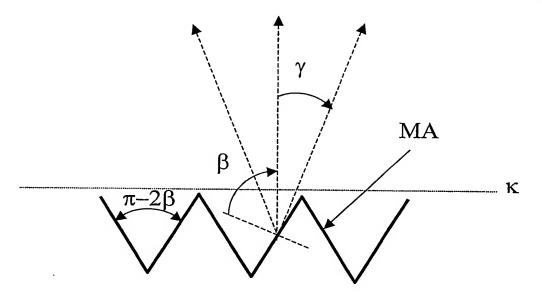
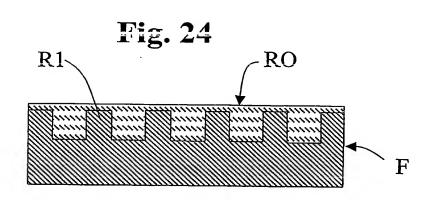
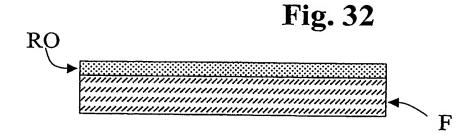


Fig. 23







ing. Glencer of VOTARO
N. scrz. Albo 258
In proprio e per gli elini

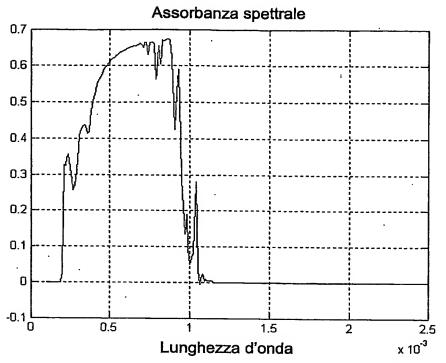


Fig. 25

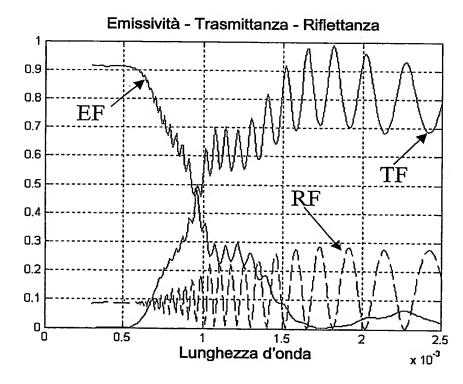


Fig. 26

ing. Glancario MOTARO N. isfliz/ALBO/258

2003A000166

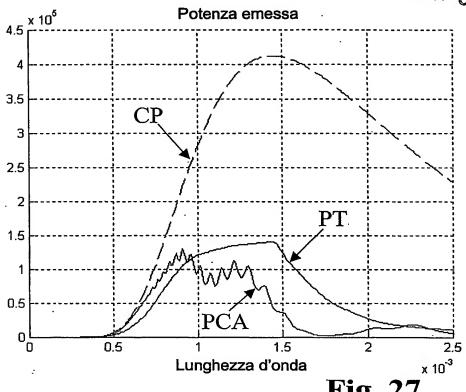
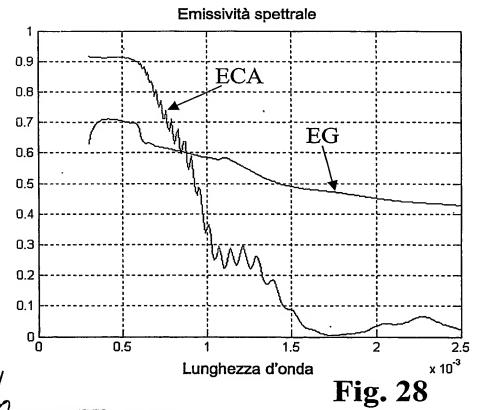


Fig. 27



DI COMMERCIO A ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

ing. Glancaria

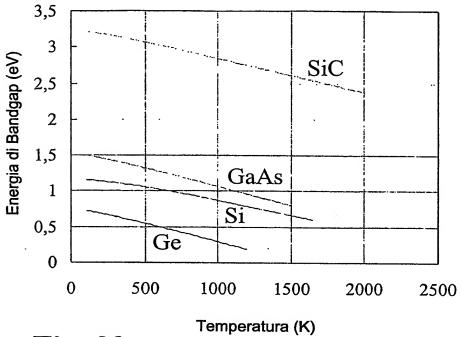
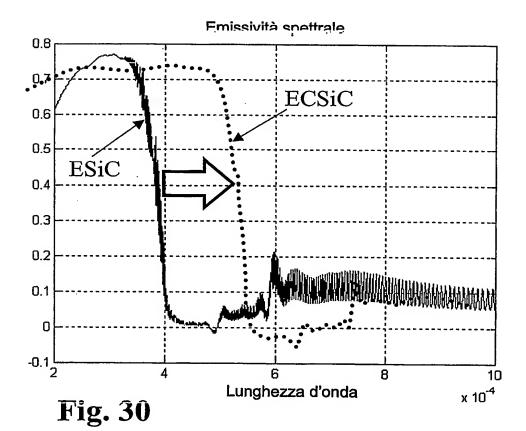
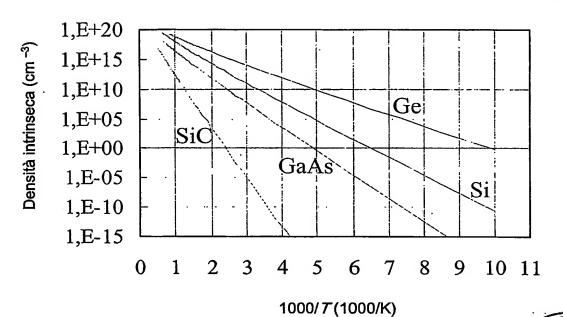


Fig. 29



Ing. Gioncorlo XIDTARO
N. Iscriz Alino 258
I in proprio a per gli oliri



**Fig. 31** 

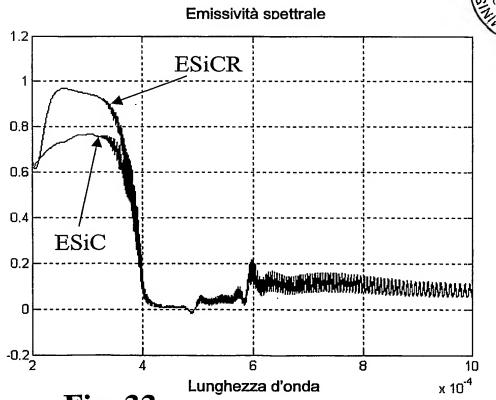


Fig. 33

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

Ing. Glancarlo NOTARO
N. Iscriz. ALUC 158